【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成19年2月8日(2007.2.8)

【公開番号】特開2005-238361(P2005-238361A)
【公開日】平成17年9月8日(2005.9.8)
【年通号数】公開・登録公報2005-035
【出願番号】特願2004-49212(P2004-49212)
【国際特許分類】
Ｂ２４Ｄ　11/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２４Ｄ　11/00　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成18年12月14日(2006.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
極細短繊維からなる絡合不織布と高分子弾性体とを一体化せしめた複合体からなる磁気ディスクの研磨布であって、該研磨布に含まれるチタン化合物の含有量が研磨布の重量に対するチタン重量にして１００ｐｐｍ以下であることを特徴とする研磨布。
【請求項２】
極細短繊維からなる絡合不織布と高分子弾性体とを一体化せしめた複合体からなる磁気ディスクの研磨布であって、該研磨布に含まれるチタン化合物の含有量が研磨布の重量に対するチタン重量にして３０ｐｐｍ以下であることを特徴とする研磨布。
【請求項３】
極細短繊維からなる絡合不織布と高分子弾性体とを一体化せしめた複合体からなる磁気ディスクの研磨布であって、該研磨布がチタン化合物を含まないことを特徴とする研磨布。
【請求項４】
前記短繊維が０．３ｄｔｅｘ以下の極細短繊維であり、少なくとも片面が立毛面となっていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の研磨布。
【請求項５】
前記高分子弾性体がポリウレタンであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の研磨布。
【請求項６】
前記高分子弾性体の含有率が極細短繊維重量に対し２０～６０％であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の研磨布。
【請求項７】
前記研磨布の見かけ密度が０．２～０．６ｇ／ｃｍ^{3}の範囲にあることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の研磨布。
【請求項８】
前記極細短繊維の平均繊維径が０．３～５μｍであり、かつ繊維径のＣＶ値が３０％以下であり、前記立毛面における表面繊維本数の線密度が３０本／１００μｍ幅以上であるとともに、シート連続長手方向における上記線密度のＣＶ値が３０％以下であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の研磨布。
【請求項９】

前記極細短繊維の平均繊維径が０．５～４μｍであり、かつ繊維径のＣＶ値が１０％以下であり、さらに前記立毛面における表面繊維本数の線密度が３０本／１００μｍ幅以上であるとともに、シート連続長手方向における上記線密度のＣＶ値が１０％以下であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の研磨布。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
本発明の研磨布は、極細短繊維からなる絡合不織布と高分子弾性体とを一体化せしめた複合体からなる磁気ディスクの研磨布であって、該研磨布に含まれるチタン化合物の含有量が研磨布の重量に対するチタン重量にして１００ｐｐｍ以下であることを特徴とするものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
また、本発明の好ましい態様は、極細短繊維からなる絡合不織布と高分子弾性体とを一体化せしめた複合体からなる磁気ディスクの研磨布であって、該研磨布に含まれるチタン化合物の含有量が研磨布の重量に対するチタン重量にして３０ｐｐｍ以下であることを特徴とするものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
また、本発明のさらに好ましい態様は、極細短繊維からなる絡合不織布と高分子弾性体とを一体化せしめた複合体からなる磁気ディスクの研磨布であって、該研磨布がチタン化合物を含有しないことを特徴とするものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】